Programm

IX. Erfahrungsaustausch "Oberflächentechnologie mit Plasmaprozessen" Mühlleithen, 5. bis 7. März 2002

Dienstag, 05. März 2002 H. Neumann		
9.00	Begrüßung und Informationen der Veranstalter	
9.15	<u>J. Meichsner,</u> EMArndt-Universität Greifswald ,,Diagnostik reaktiver Molekülplasmen"	
10.00	S. Mändl, Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig	
10.20	"Plasma-Immersions-Ionenimplantation und Festkörperdiffusion"	
10.20	<u>B. Fritsche</u> , Forschungszentrum Rossendorf "Charakterisierung einer RF-Ar/N2 Magnetron-Entladung zur Abscheidung von cBN	
10.40	Dange	J. Meichsner
10.40	Pause	J. Metchsher
11.00	T. Welzel, Technische	
11.20	"Charakterisierung von Facing-Target-Magnetrons bei der CNx – Abscheidung" G. J. Peter, N. Müller und H. Zogg, Inficon Ltd, FL 9496 Balzers, Liechtenstein	
	"Energie-Messungen a	n Neutralteilchen und Ionen von eine DC-Sputter-Quelle"
11.40	K. Ellmer, Hahn - Meitner Institut Berlin "Epitaktisches Wachstum von magnetrongesputterten aluminiumdotierten ZnO-Schichten	
	auf Saphireinkristaller	
12.00		nstitut für Plasmaphysik Garching ynergismus H + Ionen"
	"Elosion von a-C.H. S	yneigisinus A + Ionen
Mittagspause HE. Wagner		
13.30	·	er, G. Marx, Technische Universität Chemnitz
13.50		oscheidung von BCN-Schichten" A. Mengel, J. Meichsner, EMArndt-Universität Greifswald
13.30		tionsverteilung von Sauerstoffatomen in einer Hochfrequenzentla-
14.10	R. Wiese, H. Kersten,	EMArndt-Universität Greifswald, F. Scholze, H. Neumann, In-
	stitut für Oberflächenr Messung von ionenst	andifizierung Leipzig ahlgenerierten Energieeintragsprofilen mit Hilfe von Thermoson-
	den"	
14.30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	rich, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung Berlin S-Diagnostik in gepulsten schichtbildenden Plasmen"
14.50		-Institut für Plasmaphysik Garching
	"Adsorption von Meth	ylradikalen auf a-C:H"
15.10	Pause	W. Jacob
15.50	H. Leiter, Astrium Mü	nchen
16.10	"Elektrostatische Raumantriebe -Entwicklungen und Einsatz" <u>F. Frost</u> , Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig	
10.10	r. fiost, mstitut fur O	ernachennoumzierung Leipzig
		on optischen Oberflächen - Möglichkeiten und Grenzen"

Seite 1 Stand: 31.01.02

- 16.30 <u>S. Grabovski</u>, H.-E. Wagner, E.-M.-Arndt-Universität Greifswald "Chemical Kinetics and Si-Etching by SF6/Ar-Microwave Plasma Jets"
- 16.50 <u>O. Gabriel</u>, K. Li, J. Meichsner, E.-M.-Arndt-Universität Greifswald "In situ Untersuchung der Schichtbildung ingepulsten HMDSO-Plasmen"

18.30-21.00 Abendveranstaltung

Diskussionsabend:

- ➤ Was erwartet der industrielle Nutzer von Plasmaprozessen und spezifischem Equipment von den öffentlich finanzierten Forschungseinrichtungen?
- ➤ Wie sollte eine effiziente Überführung von Know How durchgeführt werden und welche Probleme sind durch "Exclusiv-Forderungen" an Know How zu erwarten und wie sind sie zu lösen?"
- ➤ Welche Chancen haben junge Wissenschaftler aus öffentlichen Einrichtungen mit einer Idee als "Firmengründer"?

Podium:

Dr. Dietmar Roth, Vorstandsvorsitzender Roth & Rau Oberflächentechnik AG

Dr. Wolfgang Fukarek, Prokurist Leybold Optics GmbH Dresden

Dr. Michael Zeuner, Beteiligungsmanager enviaFuture GmbH Chemnitz

Prof. Dr.Bernd Rauschenbach, Direktor IOM Leipzig

Dr. Hans Leiter, Entwickler elektrischer Antriebe, Astrium München

Burghard Scholz, Geschäftsführer TechnoCoat GmbH Zittau

Gerald Thomas, Technologieberater Sächsische Aufbaubank GmbH

Prof. Dr. Jürgen Meichsner EMAU Greifswald, Sektion Physik

Torsten Blum, Geschäftsführer Ostec GmbH Meißen

Mittwoch, 06. März 2002

J. Friedrich

- **9.00** <u>J. W.Gerlach,</u> Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig "Ionenstrahlinduzierte Effekte bei der ionenstrahlgestützten epitaktischen Schichtabscheidung"
- 9.20 <u>Jan Hinze</u>, Hahn Meitner Institut Berlin "Reaktives Magnetron-Sputtern von CuInS2-Absorberschichten für Dünnschichtsolarzellen"
- 9.40 <u>S. Jankuhn</u>, E. Hartmann, H.Neumann, Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig "Einsatz eines objektorientierter PIC-Codes zur Beschreibung von Plasmaquellen"
- 10.00 <u>Stefan Sienz</u>, Institut für Oberflächenmodifizierung Leipzig "In situ Spannungsmessungen bei der Ionenimplantation in GaN-Dünnschichten"
- 10.20 <u>D. Labruier</u>, Deutsches Wollforschungsinstitut Aachen "Behandlung von Polyester im Fluorcarbonplasma"
- 10.40 <u>E. Schubert</u>, H. Neumann, M. Schubert*, C. M. Herzinger**, J. A. Woollam**, Institut für Oberflächenmod. Leipzig, *Universität Leipzig, **University of Lincoln, Nebraska "Dielektrische Funktionen polykristalliner und amorpher Tantaloxidschichten bestimmt mit Spektralellipsometrie von 0,03 eV bis 8,5 eV"
- 11.00 <u>J. Meinhardt</u>, W. Bondzio*, R. Mehnert, Institut für Oberflächenmod. Leipzig, *LPKF AG Garbsen
 - "Laserstrukturierbare kombinierte PVD- und PECVD- Schichtsysteme für die Sensorik"
- 11.20 <u>V. Weiss</u>, Hahn Meitner Institut Berlin
 - "In situ-Untersuchung des Wachstums von MoSx-Schichten durch energiedispersive Röntgenbeugung während des Magnetron-Sputterns"

Seite 2 Stand: 31.01.02

- 11.40 <u>A. Fritz</u>, A. Schönhals, R. Mix, G. Kühn, J. F. Friedrich, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung Berlin "Untersuchung von pulsplasmapolymerisierten Copolymeren des Systems Allylalkohol-Alken mittels dielektrischer Relaxationsspektroskopie"
- **12.00** M. Tartz, E. Hartmann, H. Neumann, Institut für Oberflächenmod. Leipzig "Einflüsse von Justierfehlern im Multiaperturgittersystem auf den Ionenbreitstrahl"

12.20 Mittagspause

Donnerstag, 07. März 2002

K. Ellmer

- **9.00** <u>B. Rauschenbach,</u> Institut für Oberflächenmod. Leipzig "Ionenstrahl-gestütztes Schichtwachstum"
- 9.45 <u>K. Zimmer</u>, J. Dienelt, B. Dahte, H. Neumann, Institut für Oberflächenmod. Leipzig "Einsatz eines getakteten Ionenbreitstrahls für CAIBE-Prozesse"
- **10.05** R. Deltschew, M. Tartz, H. Neumann, E. Hartmann, Institut für Oberflächenmod. Leipzig "Sputterrateuntersuchungen an kohlefaserverstärktem Graphit"
- 10.25 <u>M. Bauer</u>, Max-Planck-Institut für Plasmaphysik Garching "Schichtwachstum in gepulsten Plasmen: In-Situ-Diagnostik Pulsaufgelöst?"

10.45 Pause

S. Mändl

- 11.05 <u>A. Geschewski</u>, Deutsches Wollforschungsinstitut Aachen "Untersuchung der Tiefenwirkung eines O2- Niederdruckplasmas auf Polypropylenvlies anhand eines Schichtmodells"
- 11.25 <u>F. Scholze</u>, Institut für Oberflächenmod. Leipzig "Programm zur Berechnung von Ionenstrahl- und Sputterschichtverteilung zur Geometrieberechnung von Ionenstrahlsputterapparaturen"
- 11.45 <u>G. Kühn</u>, R. Mix, J. Friedrich, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung Berlin "Die Anwendung der pulsplasmaaktivierten chemischen Copolymerisation zur Erzeugung haftvermittelnder Plasmapolymerschichten mit unterschiedlicher Art und Dichte an funktionellen Gruppen in Al-PP-Verbunden"
- 12.05 <u>M. Nitschke</u>, Institut für Polymerforschung Dresden "Ultrahydrophobie Wie man ein altbekanntes Konzept um eine neue Idee erweitert"

12.25 Mittagspause

Seite 3 Stand: 31.01.02